



ダブルテーブル/シャトル式
Double table on shuttle mechanism

● LULはご要望仕様に合わせたご提案が可能です。
We can propose the LUL following customer's requirement

FC-CSP/大型個片基板向け 高精度検査装置

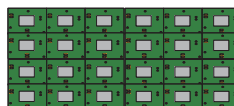
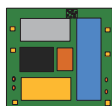
High accuracy inspection system for FC-CSP /
Large size single unit PKG substrate

チップレットなどの大型・多ピン基板対応
For large size substrate like chiplet with many test points

個片仕様/シート仕様の2モデルラインナップ
2 types for single unit or sheet inspection

アドバンスドパッケージ対応導通絶縁検査装置 Advanced Package inspection system

総合アライメント精度 $\pm 2.5\mu\text{m}$
Comprehensive alignment accuracy $\pm 2.5\mu\text{m}$



Key Specification (Unit Type)

検査部 Inspection section	Double Shuttle Mechanism 2Units/Shuttle (1Press/Unit)
Maxピン数 Maximum Test point	Top/Bottom: 32,768pts (4Kch*8QD-Block)
ワークサイズ Work Size	□15~120mm
ワーク厚み Thickness	0.5~2.0mm Holding by end face clamps
KOZ(MIN)	0.0mm
総合アライメント精度 Alignment accuracy	$\pm 2.5\mu\text{m}$
ワークホルダ Work Holder	End face clamp (by 4 side)
プレス能力 Press capability	Upper / Lower: max100kgf Total max100kgf
装置サイズ(想定) Equipment size (expected)	(W) 1,530*(D) 2,160*(H) 1,990mm (Without L/UL)

Key Specification (Sheet Type)

検査部 Inspection section	Double Shuttle Mechanism 1Sheet/Shuttle (Step and Repeat mechanism)
Maxピン数 Maximum Test point	Top/Bottom: 32,768pts (4Kch*8QD-Block)
ワークサイズ Work Size	(W) 45~150*(D) 50~300mm
ワーク厚み Thickness	0.1~2.0mm
KOZ(MIN)	5.0mm
総合アライメント精度 Alignment accuracy	$\pm 2.5\mu\text{m}$
ワークホルダ Work Holder	2-sided clamp (on longer side) with tension mechanism
プレス能力 Press capability	Upper / Lower: max100kgf Total max100kgf
装置サイズ(想定) Equipment size (expected)	(W) 1,530*(D) 2,160*(H) 1,990mm (Without L/UL)

※開発中の装置につき、実際の仕様とは異なる場合があります。
This system is under development, so the actual machine specification could be changed.